

Doc. No.: NR080317-3

2008年3月17日

半導体製造プロセスの開発拠点「プロセス技術センター」を開設 ～世界トップを誇るウエハー洗浄技術のさらなる強化に向けて本格始動～

大日本スクリーン製造株式会社(本社：京都市上京区)の半導体機器カンパニー(社長：垣内 永次)が当社彦根地区事業所(滋賀県彦根市高宮町480-1)の敷地内で建設を進めていた、最先端の半導体製造プロセスおよび装置の新たな開発拠点「プロセス技術センター」の開設準備がこのほど完了し、2008年4月1日から本格稼働します。

今回開設する「プロセス技術センター」は、プロセス開発および装置開発を行う専用のクリーンルームと各種実験装置を備えるなど、プロセスの本質に迫る評価・解析のための小規模な実験から、プロセスの安定性を実証する300ミリウエハーの連続処理に至るまで、次世代半導体プロセスの確立に向けた幅広い研究開発が可能な施設となっています。また、デバイスメーカーや研究機関、薬品、部材メーカーとの共同開発やプロセスデモンストレーションを行う環境も充実させるなど、先進のプロセス開発のさらなる効率化、迅速化を実現します。さらに同センターは、当社半導体洗浄装置の製造拠点「Fab. FC-1、FC-2」に隣接しており、技術開発と生産技術の情報交換を緊密かつ迅速に行えるため、最先端技術を生産装置へタイムリーに導入できます。

当社は、今回の「プロセス技術センター」の開設により、世界トップシェアに裏付けられた装置への高い信頼性と、半導体の技術革新や顧客の多彩なニーズへの対応力をさらに強化します。そして、他社の追随を許さないプロセス技術を創造し、顧客満足度のさらなる向上を目指します。

<プロセス技術センターの概要>

名 称：彦根地区事業所「プロセス技術センター」
所 在 地：滋賀県彦根市高宮町480-1
敷 地 面 積：約6,600平方メートル
(彦根地区事業所の総敷地面積は約14万2,000平方メートル)
建 築 面 積：約3,900平方メートル
延 べ 床 面 積：約1万1,200平方メートル
構 造：鉄筋コンクリート造り 3階建て
総 経 費：約80億円
着 工：2007年4月
開 設：2008年4月
主 な 用 途：半導体製造プロセスの研究・装置開発



プロセス技術センター

☆ この画像の印刷用データ(解像度300dpi)は、下記URLよりダウンロードできます。
(www.screen.co.jp/press/nr-photo/)

●本件についてのお問い合わせ先

大日本スクリーン製造株式会社 本社広報室：Tel 075-414-7131 Fax 075-431-6500 〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目